

Актуализированный перечень услуг ЦКП ИФМ РАН
по состоянию на 2019 год

	Наименование Услуги	Стоимость работ в час*, руб.
1.	Рентгеновский дифракционный анализ эпитаксиальных слоев (Bruker D8)	6000
2.	Рентгеновский дифракционный анализ эпитаксиальных слоев YBa2Cu3O7-d (Bruker D8)	6000
3.	Рентгеновский дифракционный анализ поликристаллических образцов (Bruker D8)	6000
4.	Анализ тонких слоев методом рентгеновской рефлектометрии (Bruker D8)	6000
5.	Определение отклонения среза кристаллических подложек (Bruker D8)	6000
6.	Определение параметров многослойных зеркал с помощью рентгеновской рефлектометрии. (X'PERT)	1500
7.	Определение параметров многослойных зеркал в диапазоне экстремального ультрафиолета (Стенд ИФМ)	Договорная**
8.	Определение параметров многослойных зеркал в диапазоне мягкого рентгена (Стенд ИФМ)	Договорная
9.	Элементный анализ образцов с помощью энерго дисперсионного спектрометра (сканирующий электронный микроскоп SUPRA 50VP)	12000
10.	Морфометрический анализ образцов с помощью растрового электронного микроскопа (SUPRA 50VP и NEON 40)	12000
11.	Электронная литография с использованием аппаратно-программного комплекса электронной литографии ELPHY PLUS	Договорная
12.	Нанолитография с помощью остро фокусированных ионных пучков (NEON 40)	18000
13.	Подготовка образцов для исследования методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии с помощью остро фокусированных ионных пучков	8000
14.	Анализ кристаллической структуры объектов методами просвечивающей электронной микроскопии (LIBRA 200 MC)	50000
15.	Исследование состава и структуры образцов методом спектрометрии характеристических потерь электронов (LIBRA 200 MC)	50000
16.	Анализ поверхности с помощью сканирующий зондовой микроскопии (NTEGRA Prima)	3000

17.	Анализ поверхности с помощью интерферометра белого света (Talysurf)	1500
18.	Послойный элементный анализ методом вторично-ионной масс-спектрометрии. (TOF.SIMS 5)	25000
19.	Определение квантовой эффективности в кремниевых светоизлучающих структурах, легированных эрбием	Договорная
20.	Исследование спектров пропускания, фотопроводимости, люминесценции и стимулированного излучения полупроводниковых структур, кристаллов и диэлектрических материалов методом Фурье-спектроскопии.	Договорная
21.	Измерение вольт-амперных характеристик сверхпроводящих мостиков и джозефсоновских переходов	2500
22.	Измерение транспортных (осцилляции Шубникова - де Гааза) и оптических в терагерцовом диапазоне (фотопроводимость, циклотронный резонанс) характеристик гетероструктур при низких температурах	15000
23.	Исследование морфологии поверхности методом СЗМ с использованием вакуумного оборудования с системой виброзащиты	3000
24.	Исследование морфологии поверхности с использованием сканирующего зондового микроскопа «Solver-P7LS»	2500
25.	Подготовка объектов для электронной микроскопии с использованием комплекта оборудования Balzers с установкой ионного травления	4500
26.	Подготовка подложек и очистка образцов с использованием системы очистки с помощью кислородной плазмы	6000
27.	Фотолитография с использованием установки совмещения и экспонирования для получения заданного рисунка микронного разрешения на плоских подложках	5000
28.	Напыление металлов, диэлектриков, сверхпроводников, органических полупроводников	Договорная
39.	Быстрый термический отжиг микроструктур с использованием установки AcuThermo AW 410 System	4000
30.	Контактной фотолитография с использованием установки экспонирования SUSS MJB4	5000
31.	Измерение магнитооптических эффектов Керра и Фарадея в тонких магнитных плёнках	4000
32.	Нанесение и обработка тонкопленочных структур с использованием ионно-плазменного комплекса	Договорная
33.	Травление и осаждение тонких пленок в установке реактивного ионного травления и осаждения с источником индуктивно связанной плазмы PlasmaLab 80	10000
34.	Лазерная литография с использованием лазерного генератора микроизображений mPG101	5000
35.	Ионно-пучковое травление, полировка и коррекция формы поверхности малогабаритными и квазипараллельными ионными пучками с использованием стенда ионно-пучкового травления	Договорная

36.	Нанесение тонкопленочных и многослойных покрытий (до 4 различных материалов) с использованием установки магнетронно-ионного напыления многослойных структур	Договорная
37.	Нанесение тонкопленочных и многослойных покрытий (до 6 различных материалов) с использованием установки магнетронно-напыления многослойных структур	Договорная

* Предварительная стоимость работ без учета подготовки образцов, с учетом НДС 20%. В случае нестандартных образцов, где требуется доработка методики, работы ведутся в форме договора на выполнение НИР, а стоимость работ согласовывается отдельно.

** в зависимости от сложности выполнения работ и стоимости расходных материалов.

Руководитель ЦКП
д.ф.-м.н., профессор



В.И.Шашкин